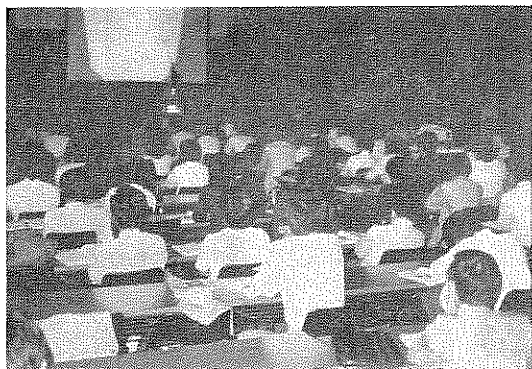


CONFERENCE REPORTS

第5回表面科学基礎講座 ——表面分析の基礎と応用——

最 上 明 矩

日本電子(株) 〒196 東京都昭島市中神町 1418
(1986年7月2日 受理)



The 5th Surface Science Lecture Course

Akinori MOGAMI

JEOL Ltd.

1418 Nakagami, Akishima-shi, Tokyo 196

(Received July 2, 1986)

第5回表面科学基礎講座——表面分析の基礎と応用——は、6月4日(水)から6日(金)にかけて東京お茶の水総評会館にて開催された。参加人員は180名を越えこれまでの本基礎講座としては最高的人数であり、この分野の関心の高さを示したものであった。

プログラムの内容については表を参照されたい。今次の企画は次のような考え方に沿って建てられた。すなわち、極めて多岐に渡る表面分析手法を目的指向的に、組成分析、化学状態解析および構造解析の3種類に大別した上で、さらにそれぞれに関し現在製品として定着、あるいは手法として確立したものを三種選んだ。なかには

例えば走査型オージェ分光装置のように、組成・化学状態・構造のすべてにわたって使用されるものもあるが、このような場合最も代表的な使われ方を考慮して分類した。

分類された各分析手法に関し、原理・装置から応用に至るまで、基礎的な解説がなされた。

各日の3つの講演の後約1時間総合討論がもたれた。参加者の大半が民間会社の分析関係の方であったせいか、日常業務で問題になっている事についての質問・討論が多かった。1時間の討論では足りない位活発であった。

各講師の先生方には、資料の作成から講演・討論に至るまで、労を惜しまず御協力をいただき、改めて深く感謝申し上げたい。

なおテキストは本講座用に特別に作成されたもので、内容は極めて充実している。若干残部があるので入手御希望の方は、本会事務所に連絡願いたい。

表 1

月 日	講 義 題 目	講 師
6月4日(水) 元素組成分析 を中心として	X線マイクロアナライザー (EPMA) オージェ分光法 (AES/SAM) 二次イオン分析法 (SIMS/IMA) 総合討論	平田 衡 (日本電子) 吉原 一祐 (金材技研) 多賀 康訓 (豊田中研)
6月5日(木) 化学状態解析 を中心として	光電子分光法 (ESCA) 赤外吸収 (FT-IR): ラマン分光 低速電子エネルギー損失分光 (EELS) 総合討論	福田 安生 (日本鋼管) 伊藤 正時 (慶大理工) 大島 忠平 (無機材研)
6月6日(金) 構造解析 を中心として	電子顕微鏡 (TEM, SEM) 電子線・X線回折 (RHEED, XRD) 電界イオン顕微鏡 (FIM-AP) 総合討論	板東 義雄 (無機材研) 井野 正三 (東 大) 西川 治 (東 工 大)